

圖二 二維 X 光繞射光束線實驗站示意圖。

在樣品支撐系統方面,TPS 20A 採用整合式多功能平台,結合毛細管自動校正系統與六軸精密平台 (hexapod)。毛細管樣品可透過自動定位系統快速準確地架設,並可與機械手臂整合,實現高通量的自動操作。對於如薄膜、平面材料、鈕扣電池等非常態樣品,六軸精密平台則提供穩定、精細的六軸調整能力,以因應複雜的實驗條件。

整體而言,TPS 20A 二維 X 光繞射光束線不僅強化了 偵測器效率與樣品支援能力,更拓展了 X 光粉末繞射技術 於功能材料、能源材料與低維結構等前沿領域的應用深度。 其實驗設計支援多種操作環境下的原位測試,包括溫度控 制、壓力變化、氣體流動、電化學反應與電池充放電等臨場 實驗,對於深入探索材料結構與性質之間的關聯具有重要助 益。

未來,本中心所屬的兩條粉末繞射光束線 TPS 20A 與 TPS 19A 將朝向功能分流的方向發展,逐步明確區分實驗類型與應用範疇。TPS 19A 將發揮其高 X 光通量與寬能量範圍的優勢,聚焦於高解析度粉末繞射等結構精修實驗;而 TPS 20A 則將專注於具特殊需求之實驗條件,如較長反應時間、變溫控制、原位追蹤等複雜實驗設計。用戶可參考表

表一 TPS19A 以及 TPS20A 光束線特性比較。

	TPS 20A	TPS 19A1
能量範圍	10 - 25 keV	10 - 40 keV
偵檢器 系統	二維大面積偵檢器 (Eiger2 S 16M)	線性 / 點偵檢器 (MYTHEN 18K/ Multi-crystal analyzer)
解析度	中 - 高	高 - 超高
適合樣品 類型	粉末毛細管、薄膜、電 池及塊材等	粉末毛細管為主
臨場環境 設備	熱風槍、氮氣致冷系統、電位儀、氣體裝載系統 及高溫腔體等	

一所列之光束線特性比較,依據實驗需求選擇最適合之光束 線進行申請。

作為台灣同步輻射研究設施的重要進展,TPS 20A 二維 X 光繞射光束線的建置代表著國內材料結構分析能力的重大躍升。此光束線提供一個功能強大且高度多元的實驗平台,將促進新材料的研發並深化跨領域合作研究。預計將於2025 年下半年完成建置後進行出光測試與用戶實驗邀請,並於2026 年第一季正式開放外部用戶申請使用。

參考文獻:

- 1. Malcolm A. Halcrow, Chem. Soc. Rev. 42, 1784 (2013).
- 2. Jia-Kai Hu et al., Small 21 (4), 2408773 (2025).

用戶資訊

實驗計畫申請

 ■ 2026-1 期實驗開放申請
2026 年第一期 (2026 年 1 - 6 月) 光束線使用於 2025 年 7 月初開放申請,截止日期為
2025 年 8 月 15 日 (五),歡迎計畫主持人 踴躍上網申請。

明年即將開放光束線如下

- TPS 27A2 Photoelectron Related Image and Nano-Spectroscopy (軟 X 光光電子能 譜顯微術)
- TPS 20A1 Two-dimensional X-ray Diffraction (二維 X 光繞射)

近期光束線將退場/搬遷如下

- TLS 16A1 BM-Tender X-ray Absorption, Diffraction 光束線將於 2026-1 期退場,用 戶可移轉至 TPS 32A1 進行實驗。
- TLS 21B1 U90-(CGM) Angle-Resolved UPS 光束線將於 2026-1 期退場,用戶可移 轉至 TPS 39A1 進行實驗。
- TPS 09A2 Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES) for Semiconductor 實驗站搬遷,故於 2026-1 期暫停服務。